昭和48年 10月 3/日

特許庁長官

1. 発明の名称

(经办3名)

8. 特許出願人

株式会社 クラ (108)

4. 代 理 人

大阪市北区梅田 8 番油 新阪急ビル 株式会社 重 新 大 版 06 (346) 1351 (代表)

(6747) **弗里士 本** 

株式会社 クラレ 東京支社支社長付 電 點 東 京 03 (272) 0311 (代表)



遊化ゴム英フオト レジスト 継曲

2. 維許請求の第四

マレイン化もしくはエポキシ化した新化ゴムと ジアダド承光架装備とからたる潜化ゴム系フォト

#### 3. 発明の詳細を説明

本売明は、フォトレジスト組成物が整布される 基材に対して改良された密着性を有する類化ゴム - タアダド茶フォトレジスト組成物に関する。

写真技術により、特定な部分に活性溶剤に耐え る保護皮膜を形成し、それ以外の部分を搭性溶剤 により存储除去するフォトエッチングの技術は、 近年務密加工装として着々の技術分野で利用され り入れられ、プリント記載、オワーテレビのシャ ドーマスクの製作、トランジスタ、集積観路(IO) たどの製造に使用されている。たかでもトランジ メッと10の製造だかいてフォ

#### ① 日本国特許庁

### 公開特許公報

①特開昭 50-72702

④公開日 昭50.(1975) 6.16

48-123027 (21)特願昭

昭48. (1973) 10.3 / 22出願日

未請求

(全5頁)

6023 58 广内整理番号 7265 46 6650 57 6906 46

62日本分類

116 A415 103 BI

25(I)B2 59. G4 61) Int. C12.

G030 BLID 7/00

CO8C-19/00

H05K C09K 13/00

\*ア世事権されている。

エフテング技術にかいて、実表に耐える (フォトレジスト)に要求される点とし ては、基材に強調に付着し、物一で、ピンホール がたく、耐食性が強いことである。発来、フォト レジストとして、ポリ桂皮酸ビニル果、糖化ゴム ージアジド某コングキノンアジド某などが知られ ているが、現在IC製造用として主として使用さ れているのは、上途の性能を比較的満たしている 着化ゴムージアジド系のものである。IOを製造 する際にフォトレジストは、茎材たとえばシリコ ンの表面を酸化して得られた酸化シリコン(810g) の活性溶剤に対する保護皮膜として用いられる。 現在一般に使用されているフォトレジストでは、 マスタを施された基材を活性溶剤でエフチングす る際に、第1回に示したよりに、フォトレジスト 皮膜が基材表面からめくれ易いことが構築されて

特別 昭50-72702(2)

のと考えられ、アンダーカットの原因となつてい る。アンダーカットが超とれば、必要な部分まで 活性溶剤により除去され、不合格製品となる。と のため、ある程度のアンダーカットを見込んでパ ターンを作つているのが現状である。しかしなが、 ちェジクトロニクス技術の急速な発展にともない。 ICはますます集務度を上げ、LSIPWOS型・ ICの開発が進み、より高性能のフォトレジスト が望まれており、特に前述のアンダーカット巾の 可能を限り小さいものが求められている。IC用 フォトレジストの蒸材である酸化シリコン(8102) の表面は、微量の水分と反応してシッノール (S108) のようにをつているといわれている。そのため無 極性の環化ゴムをレジストとして用いた場合には、 極性基であるの日との相互作用がほとんどなく、 環化ゴムの分子量、二重結合量、分子量分布等を 変えても、現在の環化ゴムより酸化シリコンへの 密着性が大きく改良される可能性は少ないと考え られる。現在までに、環化ゴム果フォドレジスト の基材、例えば酸化シリコン等に対する密着性の

ル酸メチル、メタアクリル酸メチル等との共産合体に、塩化鉄、塩化アルミニウム、四塩化錫、四塩化錫、四塩化銀、四塩化銀等、三臭化ビスマス、五塩化アンチモ、低体、固体の環化研索、五塩化燐等の気体、低化、固体の環化用させることによっては、ボーシーの調製に使用する環化ゴムとしては、フォトレジスト用に通常使用されていたとしては、フォトレジスト用に通常使用されていたとしては、フォトレンスト用に通常使用されていたとしては、フォトレンストのが好きしいが、一般にトレエン中30℃における極限粘度(カ)0.1~

本発明にないて使用されるマレイン化した環化 ゴムは、①現化ゴムを無水マレイン酸と反応させ て得られる暖化ゴムー無水マレイン酸付加物、② とうして環化ゴムに導入された無水マレイン酸を、 必要に応じてロートルエンスルホン酸のような触 蝶の存在下、メタノール、エタノール、ローブタ ノール等のアルコール、またはアンモニア、ロー プロビルアミン等のアミン類と加熱反応させて、 改良方法としては、慈材の表面に密着性改良のための物質を独布したのち、フォトレジストを整布する方法や、フォトレジスト中に密着性改良のための物質を添加する方法が提案されている。しかしながら、前者の方法では作業の工程が増えるという欠点があり、また添加や独布する物質が高値であつたり、有毒であつたりして、必ずしも充分満足すべきものではない。

本発明は、上期間題を解決し、基材とくに表面がシラノール状の酸化シリコンに対する密着性を改善した環化ゴム系フォトレジストを明らかにするものである。すなわち本発明によれば、マレイン化もしくはエポキシ化した環化ゴムとジアジド系光架緩剤とからなる、基材に対する密着性の改善された環化ゴム系フォトレジスト組成物が提供される。

環化ゴムは、公知のように、天然ゴム、ジェン 系合成ゴム例をばポリイソブレン、ポリブタジェン、共役ジェンと他の不飽和単量体例をばスチレン、メチルスチレン、アクリロニトリル、アクリ

ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素、あるいは芳香族炭化水素とn-ヘキサン、n -ヘブダン等の飽和脂肪族炭化水素とn-ヘキサン、n -ペブダン等の飽和脂肪族炭化水素との混合物を 溶媒として、ラジカル発生酸媒の存在下、温度 40~100 C で溶液状で反応を行なりのが特に好 ましい。ラジカル発生酸媒としては、ビニル化合 物の番常のラジカル重合に使用されているものを 思いるととができる。。

本発明にかいて、上記受性調化ゴム中の無水マレイン酸性をはその誘導体の付加量は、選化ゴム100% あたり 5×10 % ~ 4×10 % モルが適当であり、またエポキシ蒸( 0 ~ 0 ) の含量は、数ゴム100% あたり 5×10 % ~ 8×10 % モルが適当である。数要性硬化ゴムは、それ単独で使用してもよ

レイソプレン発展整備関係タラブレンIR-10)
10.0 f をキャレン190 f に溶原し、P-トルエンスルホン酸 1.0 f を加えて、90~100 G で変楽家職気中1時間提择した。室温をで冷却したのち炭酸 n ルッウムを加えて反応を停止させた。反応液を遠心分離機にかけ、上澄み液を多量のアセトン中に注ぎ、生成した沈殿を減圧下、室温で乾燥した。得られた環化ゴム()は不飽和度44%、振眼粘度〔1〕(トルエン中30 G)0.70(d/f)であつた。

#### (2) 華化ゴムー無水マレイン酸付加糖の製造

前記(1)で得られた理化ゴム(I) 2.0 『をキシレン48』に溶解したのち、無水マレイン酸 0.2 『を 単加し、さらにアゾピスイソプチロニト 『ル 0.004 『を加え、窒素雰囲気中 9 0 0 で 5 時間反応した。 反応混合物をアセトン中に投入し、沈酸を消別して は低下電温で乾燥した。反応生成物をペンゼン に溶解し、エミノールーペンゼン混合溶剤(1: 4 容量比)の水酸化ナト 『ウム溶液を用いて、フ エノールフォレインを排示薬として消定し、無水 く、変性していたい輩化ゴムと場合して使用して もよい。

本発明のフォトレジスト組成物の製造にあたり、 光架器類としてのジアジドは、一般に潜化ゴムー ジアジド系フォトレジストの光架器類として使用 されているアリールビスジアジドが、通常の使用 量の範囲で用いられる。 典型的なものとしては 4.41ージアジドステルベン、 2.6 ーピス( 4 ーア ジドペンジリデン)ー 4 ーメテルシケロヘキサノ ン、アーフェニレンーピスアジド等である。

本発明のフォトレジストは、単に基材に対する 密着性が著しく向上しているはかりでなく、感光 度、耐腐飲剤性にも優れてかり、その優れた密着 性、耐腐蝕剤性、感光度のために、特に半導体IC の製造の際の歩留りの向上、集積密度の向上に大 きく寄与するものである。

以下に実施例により本発明を具体的に説明する。

(1) 環化ゴム(1) の製造

楽練りしたシスー 1・4 ーポリイソブレン(タワ

マレイン酸の付加量を測定した。無水マレイン酸の付加量は硬化ゴム100%あたり 6×10 で モルであつた。

#### 13) 潜化ゴムーマレインイミド付加物の製造

(i) で得ちれた環化ゴム(j) 2.0 『をキシレン48 『に海解したのちマレインイミド 0.2 』を垂加し、 さらにアゾビスイソプチロニトリル 0.004 『を加 え、臨業雰囲気中 9 0 で 5 時間反応した。反応 混合物を多量のメダノール中に投入して沈敞を評 別し、減圧下室温で乾燥した。

#### (4) 環化ゴム(肌の製造

素板 りしたシスー1.4 ーポリイソプレン(クラレイソプレン解製クラプレンIR-10)10.0 『をキシレン190』に溶解したのちアートルエンスルホン酸 0.5 』を加え、金素雰囲気中100 Cで5時間提择した。宝温まで冷却したのち炭酸カルシウムを加えて反応を停止した。反応液を適心分離機にかけ、上澄み液を多量のアセトン中に注ぎ、生ま沈泉を評別し、減圧下室温で乾燥した。得られた硬化ゴム(同は不動和度45%、通元粘度(farr/a)

1.1 ( a : 0.3 #/100 m トルエン、50℃)で あつた。

(8) エポキシ化薬化ゴムの製造

(4)で得られた選化ゴム(計1.5 f をベンゼン100 のに溶解し、ヨーケロル通安息音像 0・25 f を加 えて電温で7時間提择した。次いで多量のアセト ン中に注いで沈泉を評別し、減圧下電温で乾燥し た。

前配(1)~(5)で得られた滞化ゴ上(1)、信か上び変性悪化ゴムをそれぞれキシレンに溶解し、光架響剤として2.6 ーピス(4 ーアジドベンジリデン)ー4 ーメチルシケロヘキサノンを滞化とし、ステイ・メチルシケロペキサノンを滞化とし、ステイドガラスにスピンナーで動布し、乾燥して厚さ0.6 年の被除とした。90℃で15分間プレベーキングし、ネガマスタを凝して250ツット超高圧水銀灯(ウシオ電気製)にて所定時間部光した。キシレン中で1分間現像した。現像後乾燥し、120で20分間ポストペーキングした。

得られたいジスト被勝を 0.5 ガフツ化水素機

て行をつた。要先顕微鏡用ステイドガラス(マッチをガラス社製)に、フォトレジスト海便を敬むし、厚さ 0.4 年の皮膜とした。資達のようにしてパターンを作成し、0.5 %ファ化水業機(ソッ化アンモニウムを含む)中に復温で3 0 分間長波してエフテングを行なつた。エフテンダ液をのパターンを顕微鏡で頻楽してアンダーカット市を測定した。

### 4. 郷御の簡単を説明

第1回は、エッチングに際し、フォトレジスト 皮膜が基材に被脳に付着している良好な状態を示 し、第2回は数皮膜が基材表面からめくれている 不良な状態を示す断面略節である。

> 特許出版人 株式会社 ナーラール 代 理 人 弁理士 木 多 包

特朗 昭50-72702 (4)

(ファ化アンモニウムを含む)中に宣風にて 8 g 分間浸液を行なつたところ、レジスト被傷の動腐 検剤性は、前記(2)、(5) かよび(5) で得られた変性器 化ゴムを使用した場合と。(1) かよび(4) で得られた 米受性等化ゴムを使用した場合とも優れてかり、 両者にはほとんど差がみられなかつた。アンダー カット巾について測定した結果を表1 に示す。

表1 フッ化水素限中への30分間

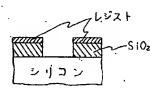
浸漬による アンダーカツテイング

联邦	(1) (未処理)		(3) マレイミド(L)	(4) (未処理)	(5) (五時代)
アンダーカット 中 (#)	6 1	4 7	4.8	6 3	4 9

前記(1) かよび(4) で称られた未変性の著化コムをベースポリマーとした場合と比較すると、(3)、(3) かよび(5) で得られた変性悪化コムをベースポリマーとして使用した場合には、薬材に対する審着性が楽しく内上しているととがわかる。

たか、アンダーカット巾の耐定は次のようにし





第2回アンダーカットウ



#### 5. 添付書類の目録

(1) 副 本 1 通 (2) 明 細 書 1 通 (3) 委 任 状 1 通

#### 6.前配以外の発明者

タランキンサネズ 関山県倉敷市温津 1 6 2 5 イケーメーロウ・ターロウ 油 田 禁士部

###マレノプトキ . 関山市延友 1 8 9 の 9 イマ イ += ## 今 井 清 和

\* ヤ がり ( イ \*\*\*) 大阪府寝屋川市三井が丘 1 の 8 イ ズ ( \*\*\* /『 和 泉 正 劇

# <Publication No. JP-A No.50-72702> Title "Cyclized Rubber Photoresist Composition"

## Page 2 right upper column line 17 to page 3 right upper column line 2

As generally known, cyclized rubbers can be obtained by applying a cyclizing agent of a gas, liquid, or a solid substance such as ferric chloride, aluminum chloride, tetrachloride tin, tribromide, tetrachloride titanium, bismuth antimony pentachloride, boron trifluoride, boron trichloride, and phosphoric chloride to a copolymer of: a natural rubber or a diene synthesized rubber such as polyisoprene, polybutadiene or a conjugatediene , and another unsaturated monomer such as styrene, methylstyrene, acrylonitrile, methyl acrylate and methyl methacrylate. As a cyclized rubber used for the preparation of the malleine reacted or epoxidized cyclized rubber of the present invention, it is preferable to use one generally used for photoresist. In general, a cyclized rubber having a limiting viscosity  $(\eta)$  of 0.1 to 2.0 (dl/g) and an unsaturation degree of 20 to 70 % in toluene at 30 °C can be used.

The mullein reacted cyclized rubber used in the present invention includes the followings: (1) an adduct of cyclized rubber-maleic anhydride obtained by reacting a cyclized rubber with maleic anhydride; (2) a substance obtained by heating and reacting the maleic anhydride thereby introduced into the cyclized rubber with an alcohol such as methanol, ethanol or n-butanol, or with ammonia, or amines such as n-propylamine, under the presence of a catalyst such as n-toluenesulfon if needed, and by amidating/imidating/making one side or both sides of a carboxyl group based on the maleic anhydride into a structure of an ester corresponding thereto; (3) a substance in which an acid anhydride group of the maleic anhydride introduced into the cyclized rubber is hydrolyzed and made into a free carboxyl group or a metal group thereof; and (4) a

substance obtained by reacting the cyclized rubber with maleic anhydride derivative such as alkyl-substituted acid anhydride, esterified acid anhydride, amidated acid anhydride, or maleimide. The reaction between the cyclized rubber and a maleic anhydride or a derivative thereof can be conducted simultaneously to the reaction between a normal rubber and maleic anhydride (see for example US Patent No. 2,622,874 and Japanese Patent Application Publication Laid-Open No. SHO 47(1972)-26167).

It is particularly preferable to carry out the reaction in a solution status at temperature of 40 to 100  $^{\circ}$ C under a presence of a radical generating catalyst with a an aromatic hydrocarbon such as benzene, toluene and xylene as a solvent, or with a mixture of an aromatic hydrocarbon and a saturated aliphatic acid hydrocarbon such as n- hexane and n- heptanes as a solvent. As a radical generating catalyst, a vinyl compound generally used for radical polymerization can be used.

Further, the epoxidized cyclized rubber used in the present invention can be obtained by reacting through a conventional means a cyclized rubber in an inert solvent such as benzene, toluene, chloroform and n- hexane, with an organic peroxides such as acetyl hydroperoxide and perbenzoic acid; an organic hydroperoxides such as t- butylhydroperoxide, cumene hydroperoxide; and a hydroperoxide such as hydrogen peroxide. A cyclized rubber having an epoxy group in its side chain can also be obtained by reacting an unsaturated compound having an epoxy group such as butadiene monoxide, allyl glycidyl ether and glycidyl acrylate under a presence of a radical generating catalyst.

In the present invention, the amount of the acid anhydride or a derivative thereof added in the above-mentioned modified cyclized rubber is suitably  $5 \times 10^{-4}$  to  $4 \times 10^{-8}$  mol per 100 g of the cyclized rubber, and the amount of an epoxy group

("\\_")

is suitably  $5 \text{x} 10^{-4}$  to  $8 \text{x} 10^{-8}$  mol per 100 g of the

cyclized rubber. The modified cyclized rubber can be used alone or in combination with an unmodified cyclized rubber.